

J-PEAKS 導入装置

分類	機器名	型番
表面観察	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡※	JSM-IT810(SHL)
	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡システム	JSM-IT810(SHL)PRIME
	エネルギーフィルター走査電子顕微鏡システム	JAMP-Z22011EFS
	超解像共焦点レーザー顕微鏡	-
	白色共焦点顕微鏡	HYBRID+C3-TZ
結晶構造解析	溶液分子状態解析システム	BIOMAXS/EDT
	高エネルギー線源搭載X線回折装置	SmartLab XE/RA/Ag
	卓上型小角X線散乱装置	NANOPIXmini
	デスクトップX線回折装置	MiniFlex600-C/XSPA-200ER
	結晶構造解析システム	XtaLAB Synergy-ED
非破壊検査	実験動物用マイクロX線CT※	CosmoScanFX
元素分析	微小部X線分析装置	XGT-9000
	エネルギー分散型蛍光X線分析装置	NEX CG II
	ICP発光分光分析装置	Agilent 5800 VDV
	有機微量元素分析装置	MICRO CORDER JM11
質量分析	ガスクロマトグラフ質量分析計	GCMS-QP 2050-AOC-6000
	液体クロマトグラフ質量分析計	LC/MS Ultivo
	未知物質解析システム	JMS-T200GC
	イメージング質量顕微鏡	iMScope QT
吸収分光	ピコ秒過渡吸収分光システム	picoTAS-ns-W2X
分光分析	顕微レーザーラマン装置	LabRam Odyssey

共用機器

分類	機器名	型番
表面観察/分析	透過型電子顕微鏡	JEM-2100plus、JEM-2100、JEM-1010
	クライオ透過型電子顕微鏡※	Talos F200C G2
	電子プローブマイクロアナライザー	JXA-8530F
	走査電子顕微鏡	JEM-6010plus、SU8010、JSM-6500F、S-3500N
	走査型プローブ顕微鏡	SPA400、SPA400 + SPI3800N
	顕微蛍光イメージング測定装置	IX-71
	金属顕微鏡システム	LV-100D
	デジタル顕微鏡	VHX-1000
	共焦点レーザー顕微鏡	STELLARIS 8
電顕用試料作製	X線光電子分光装置	ESCA-3400
	凍結切断レプリカ作製装置	EM-19501 JFDV
	急速凍結装置	CryoPress
結晶構造解析	凍結試料作製装置※	Vitrobot Mark IV
	単結晶X線回折装置	AFC11 with Saturn 724+、XtaLAB Synergy-S/Cu
非破壊検査	多目的X線回折装置	SmartLab
	X線マイクロCT	inspeXio SMX-90CT plus
元素分析	共焦点3次元蛍光X線分析装置	オリジナル装置(真空および大気仕様)
	卓上型全反射蛍光X線分析装置	NANOHUNTER II
	ICP発光分析装置	VISTA-MPX
	元素分析装置	MICRO CORDER JM10
	全有機体炭素計	TOC-LCSH
磁気共鳴	核磁気共鳴装置	Avance300 nanobay、NMR AVANCE NEO 400、Avance III HD 400、Avance III HD 600、JNM-ECZ400S、JNM-ECZ500R/S1
	電子スピン共鳴装置	JES-FE2XG、ESP380E、Elexsys E580、Elexsys E600

共用機器

分類	機器名	型番
質量分析	TOF型質量分析装置	JMS-T100LP AccuTOF LC-plus JMS-T100LP AccuTOF LC-plus4G
	MALDI TOF型質量分析装置	autoflex speed TOF/TOF、MALDI-8030
	ESI TOF型質量分析装置	micrOTOF II
	磁場型質量分析装置	JMS-700(s)
	GC質量分析装置	GCMS-QP2010Plus
	フェムト秒レーザーイオン化質量分析装置	KNTOF-1800
物性計測	磁気特性測定システム	MPMS3、MPMS XL
	物質・材料特性評価装置	PPMS-Ever cool II、PPMS
	ゼータ電位・粒径測定システム	ELSZ-DN2、Nano ZS
	接触角計	DMe-211
	比表面積・細孔分布測定装置	BELSORP-max
分光分析	分光光度計	V-660
	分光蛍光光度計	RF-5300PC、RF-6000
	フーリエ変換赤外分光光度計	FT/IR-6100
	テラヘルツ分光装置	オリジナル装置
	レーザーラマン顕微鏡	RAMAN-11
	エリプソメーター	SE-2000PV
	メスバウア分光装置	MVT-1000
分離分析	イオンクロマトグラフ	Prominence HIC-SP
	高速液体クロマトグラフ	LC-20A
遺伝子・ゲノム	次世代シーケンサー	MiSeq
	リアルタイムPCR	TP950
画像解析	ルミノ・イメージアナライザ	Amersham Imager 600
比熱・熱伝導・熱起電力測定	高感度型示差走査熱量計	DSC7020
	物質・材料特性評価装置〈再掲〉	PPMS-Ever cool II、PPMS
成膜	ロードロック式3元スパッタ装置	M09
膜評価	触針式表面形状・膜厚段差測定装置	Dektak150
	エリプソメーター〈再掲〉	SE-2000PV
	走査型プローブ顕微鏡〈再掲〉	SPA400、SPA400 + SPI3800N
	共焦点レーザー顕微鏡	STELLARIS 8
微細加工	電子ビーム描画装置	ELS-7500EX
	手動式マスクアライナ	MJB4
	集束イオンビーム加工観察装置	FB-2100
	複合ビーム加工観察装置	JIB-4700F
	集束イオンビームナノ加工顕微鏡装置	JIB-4000
超音波熱圧着ウェッジワイヤーボンダー	7476D	
光学測定	高強度フェムト秒レーザー照射装置	Alpha 100/1000/XS hybrid
	超高速レーザーシステム	Legend Elite-USP-5K-HE
精密秤量	精密電子天秤	XP-56
	マイクロ天びん	BM-5

共用施設

ヘリウム液化装置、液化窒素自動充填装置、クリーンルーム